

Microelectronics and Nanotechnology - Shamsuddin Research Centre (MiNT-SRC), Block F5,PejabatPengurusanPenyelidikan, Inovasi, PengkomersilandanPerundingan (ORICC) UniversitiTun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, BatuPahat, Johor, Malaysia. Website: mint.uthm.edu.my

RF & DC SPUTTERING BOOKING FORM

DATE	:
NAME	:
POSITION	:
SUPERVISOR NAME	:
INSTITUTION NAME	:
ADDRESS	:
PHONE NO (OFFICE)	: PHONE NO (MOBILE) :
EMAIL ADDRESS	

SAMPLE NO 1

Material of Sputter Target	
Sample Size	Length :
Material of Substrate No of Sample/deposition	
Estimate no of parameters	Deposition Power: Deposition Temperature: DC bias voltage: Working Pressure: Deposition rate: Desired Thickness:

SAMPLE NO2

Material of Sputter Target	
Sample Size	Length : (mm) Thickness : (mm) Width : (mm) . . *Maximum: length x width = 5 cm x 5 cm. . .
Material of Substrate No of Sample/deposition	
Estimate no of parameters	Deposition Power: Deposition Temperature: DC bias voltage: Working Pressure: Deposition rate: Desired Thickness:

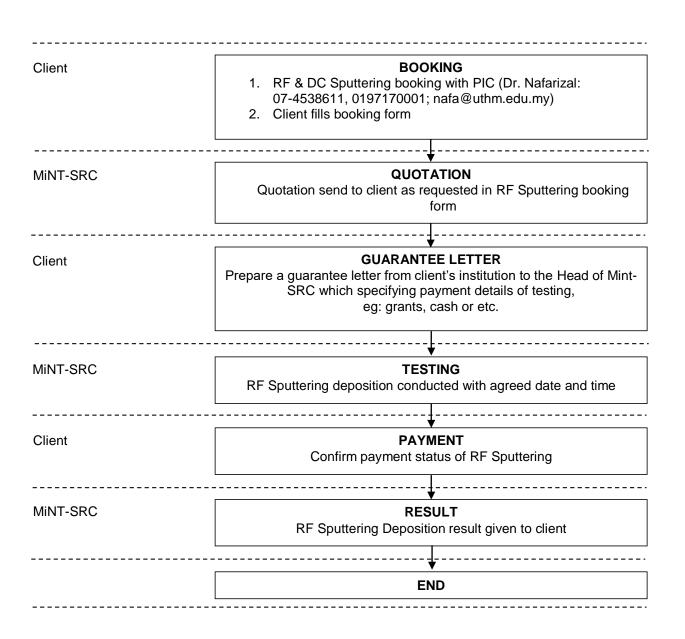
Schematic Diagram

Brief Process Details.

Note:

- 1. Please add the number of box if it is not enough.
- 2. Please fill this form and email to faezahana@uthm.edu.my
- 3. Rate for RF & DC Sputering System:
 - RM200.00 /hours + gst 6% (for universities)
 - RM300.00 /hours + gst 6% (for industries)
- 4. Permission use of RF Sputtering System is given after approval or a guarantee of payment / payment completed.

RF SPUTTERING FLOWCHART



EXAMPLE GUARANTEE LETTER

Fakulti Kejuruteraan Kimia Fakulti Kejuruteraan Kimia B1310 Johor Ba	ysia hru
UNIVERSITI TEXNOLOGI MALAYSIA	ysia
Tel: +(6 XXXXXX Faks: +(6) XXXXXX http://www.cheme.utm.my Emel:info@cheme.utm.my	
RUJUKAN KAMI: 2nd March 2014 RUJUKAN TUAN:	
Microelectronic and Nanotechnology (MiNT-SRC),	
Office for Research, Innovation, Commercialization & Consultancy Management (ORICC)	
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Batu Pahat, Johor.	
(u/p: Nurhafizah Ruslan)	
Tuan,	
	-
PERMOHONAN PEMBAYARAN FESEM MENGUNAKAN PROJEK VOT	
Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara diatas.	
Dongan segura normanya saya merujuk perkara diatas.	
2. Selaku ketua projek bagi vot XXXX saya ingin memohon kelulusan dari pihak UTHM	
untuk membayar alatan sewaan FESEM dengan menggunakan peruntukan dari Vot.	
	*
3. Butiran penggunaan alat FESEM adalah seperti berikut:	
Tarikh Penggunaan :	
Bilangan Sample: X Jumlah Bayaran : XXXX	
Junian Dayaran .	
4. Oleh yang demikian, saya memohon agar pihak tuan dapat meluluskan permohonan ini.	
Segala kerjasama dari pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.	4
Sekian, wassalam.	1.15
Yang benar.	
Assoc.Prof.XXXXXXXXXXXXXX	
Ketua Projek Vot XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Jabatan Kejuruteraan Polimer, Fakulti Kejuruteraan Kimia,UTM	
Universiti Teknologi Malaysia	
www.utm.mv inovatif • entrepreneurial • global	

